

# 光応用・視覚計測 合同研究会

〔委員長〕石井弘允（日大）  
 〔幹事〕白水俊次（長野高専），小野 隆（日大）  
 〔委員長〕関根松夫（防衛大）  
 〔幹事〕作本義孝（日電検）  
 〔幹事補佐〕白井照光（日電検）

日時 11月28日（木）11：00～16：00

場所 電気学会本部第1～2会議室（東京都千代田区五番町6-2，HOMAT HORIZONビル8階  
 JR市ヶ谷駅より徒歩5分 TEL 03-3221-7201）  
 〔企画担当：板倉安正（滋賀大），作本義孝（日電検）〕

共 賛 多角的赤外線応用基盤技術調査専門委員会（委員長 板倉安正，幹事 津田川 勝，堀  
 中博道）

協 賛 IEEE Society of Instrumentation and Measurement，Japan Chapter

議 題 テーマ「光・赤外計測一般」

LAV-02-12 二色性手法を用いたプリント基板の部品有無検査  
 IM-02-71 山羽和夫，陸開 広（日本福祉大）

LAV-02-13 デジタル複合機のカラーマネジメント  
 IM-02-72 澤田崇行（東芝テック）

LAV-02-14 サブミリ波ジャイロトロンの開発と計測への応用  
 IM-02-73 出原敏孝，光藤誠太郎，小川 勇（福井大）

LAV-02-15 テラヘルツ・エリプソメトリの開発とその半導体評価への応用  
 IM-02-74 長島 健，萩行正憲（大阪大）

LAV-02-16 短波長遠赤外レーザー開発とその応用  
 IM-02-75 中山和也，田澤寿樹，岡島茂樹，川端一男  
 田中謙治，徳沢季彦，伊藤康彦（中部大）

LAV-02-17 2台のビデオカメラと光源によるハイライト像を用いた円柱状物体の三次元位置計  
 IM-02-76 測 稲荷隆彦，青木伸也（近畿大）

LAV-02-18 マイクロマシニング技術を用いた光学式距離センサの開発  
 IM-02-77 岡 徹（三菱）